

高纯度氢气中含硫化合物的分析

使用 Agilent 8890 气相色谱仪和 Agilent 8355 硫化学 发光检测器

作者

Youjuan Zhang 和 Jie Zhang 安捷伦科技公司 中国上海

摘要

使用配备 Agilent 8355 硫化学发光检测器 (SCD) 的 Agilent 8890 气相色谱 (GC) 系统 分析高纯度氢气中的含硫化合物。使用六通气体进样阀将样品引入整个系统。使用 Agilent J&W DB-Sulfur SCD 色谱柱获得了出色的峰形和分离度。线性、重现性和检 出限 (LOD) 均十分出色,所有分析物的相关系数 (R^2) ≥ 0.9983,LOD 约为 10 ppb。 峰面积的典型相对标准偏差 (RSD) 为 0.87%-12.54%。

前言

氢气因热值高、产物无污染等优点,成为 了绿色能源的首选来源之一。氢气来源广 泛,包括天然气、煤、生物质或电解水 等。然而,由于化石燃料制氢成本相对较 低,技术更为成熟,因此一直是最常用的 方法。

原料或反应过程可能将杂质引入氢气产物 中。常见杂质包括 CO、CO₂、NH₃、硫、 甲醛等^[1]。氢气的质量控制,特别是不同 级别氢气的杂质分析,已成为氢气制造商 和用户的迫切需求。

目前已有大量文献报道了氢气中永久性气体杂质的分析:

- 使用配备微型热导检测器和两个分析 通道的 Agilent 990 微型气相色谱系统 可在 2-10000 ppm 范围内实现一些 永久性气体(He、Ne、N₂、Ar、O₂、 CO、CO₂)的快速(150 秒内)、灵 敏分析^[2]
- 使用配备脉冲放电氦离子化检测器 (PDHID)的 Agilent 8890 气相色谱仪 可通过单次进样定性和定量检测低 ppb级的永久性气体杂质和二氧化碳⁽³⁾

此外,监测氢气中的含硫化合物对于保护 昂贵的催化剂以及保证产品质量至关重 要。然而,氢气中含硫化合物的测定是一 项挑战,因为这些化合物具有较强的活 性、吸附性和金属催化性。要获得准确、 可靠的结果,需要整个系统具有出色的惰 性和灵敏度。本应用简报展示了 8890 GC 和 8355 SCD 系统在分析氢气中含硫化合 物中的应用。

实验部分

采用配备 8355 SCD 的 8890 GC 进行分析。通过与惰性挥发性物质分析接口 (VI) 直接相连的六通气体进样阀引入样品。为

实现更高的灵敏度,使用 2 mL 定量环将 更多的样品引入系统。硫化氢作为第一个 流出的峰,建议采用分流进样方法改善其 峰形。在实现高灵敏度的另一项改进中, 需要首选小分流比。因此,本研究使用 10:1 的分流比来平衡峰形和灵敏度。仪 器条件列于表 1。

使用气路控制模块 (PCM) 和全新设计的 气体混合模块(可通过 SP-1 8890-0717 订购,用于新仪器)制备 ppb 级校准标 准品。该模块被称为迷你气体混合器,是 一种集成式单级动态流稀释器,可安装在 8890 GC 的任何可用电子气路控制 (EPC) 插槽中。与之前的版本相比,它更紧凑小

表 1.	仪器	条件
------	----	----

参数	值		
Agilent 8890 GC			
进样	六通气体进样阀;阀箱温度: 150 °C		
样品定量环	2 mL		
进样口	挥发性物质分析接口;分流模式,分流比 10:1;温度:150 °C		
色谱柱	Agilent J&W DB-Sulfur SCD, 60 m × 0.32 mm, 4.2 µm(部件号 G3903-63001)		
载气	氦气,3 mL/min,恒流		
柱温箱升温程序	40 °C (1 min),以 15 °C/min 升至 230 °C		
Agilent 8355 SCD			
燃烧头温度	800 °C		
基线温度	280 °C		
H ₂ 流速上限	38 mL/min		
H ₂ 流速下限	8 mL/min		
氧化剂流速(空气)	50 mL/min		
0₃发生器流速	44.15 mL/min		
燃烧头压力	383 Torr		
反应池压力	4.9 Torr		
数据采集速率	5 Hz		

巧,更易于安装。恒定的校准混标气体流 与混合器内的基质气流混合,得到所需的 浓度。图 1 显示了样品稀释、进样和分 析设置。在本研究中,使用高纯度氢气作 为稀释气体。通过校准混标流速 (F₁) 和 基质流速 (F₂)确定稀释比。稀释公式为:

$$C_2 = C_1 \times \left(\frac{F_1}{F_1 + F_2}\right)$$

公式 1.

其中 C_2 为稀释浓度, C_1 为初始校准浓 度, F_1 为校准混标流速, F_2 为基质稀释气 体流速。

含硫气体标样购自 Air Liquide。为了尽量 减少活性含硫组分的吸附,使用惰性压力 表和惰性管线连接标准气瓶与系统。表 2 列出了含硫气体标准品的组成和浓度。 表 3 显示了 8 种混合物/稀释气体组合在 不同校准浓度下各组分的体积浓度 (v/v) (以约 1 ppm 的含硫校准混标为起点)。

使用 Agilent OpenLab 色谱数据系统 (CDS) 控制气相色谱系统,并进行数据采 集和定量分析。在 5 Hz/0.04 min 的数据 采集速率下得到了可接受的基线。

结果与讨论

利用含硫化合物实现系统平衡

分析低浓度含硫化合物的最大挑战在于如 何尽量减少活性含硫化合物的吸附,并使 样品流路快速达到硫"饱和"。建议对整 个样品流路进行钝化处理,包括气瓶压力 表、连接管、迷你气体混合器、阀样品定 量环、VI进样口、分析柱和检测器,尽 量减少活性位点。结果发现,除需要钝化 处理外,还需要通过灌注流程使钝化流路 中的含硫分析物达到预饱和。灌注时间主 要取决于样品流速和用于灌注流路的样品 浓度。



图 1. 用于含硫化合物分析的动态混合系统布局和 Agilent 8890 气相色谱仪配置。公式 1 定义了稀释公式

表 2. 混合气体标样(平衡气体: H₂)

编号	化合物名称	分子式	浓度(µmol/mol,ppm)
1	硫化氢	H_2S	0.992
2	羰基硫	COS	1.01
3	甲硫醇	CH₃SH	0.999
4	乙硫醇	C_2H_5SH	0.990
5	二甲硫醚	CH₃SCH₃	1.01
6	二硫化碳	CS ₂	1.01
7	噻吩	C_4H_4S	1.01

表 3. 稀释表(校准混标的起始浓度为每种组分约 1 ppm)

校准混标 流速 (mL/min)	PCM (H₂) 流速 (mL/min)	浓度 (ppbv)
1	99	10
1	65.67	15
1	49	20
1	39	25
1	19	50
1	9	100
1	5.67	150
1	4	200

在灌注过程中,当系统最初暴露于含硫化 合物时,观察到一些化合物的峰面积增大 (图 2)。这种增量响应现象在高活性化

合物中尤为明显,例如硫化氢、甲硫醇 和乙硫醇。在本研究中,用于灌注的校 准混标浓度约为 500 ppb,以 2 mL/min 的流速通过流路。在样品进入气相色谱 系统之前,用混标吹扫样品流路约 2 小 时。在第一次运行中没有出现硫化氢,并 且甲硫醇和乙硫醇的初始响应极低。对于 这些化合物,我们设置了一个长序列来灌 注系统。完成灌注后,重复进样 ppb 级 校准标样可获得稳定的响应(图 3)。此 外,使用灌注程序后,H₂S 和 COS 在最 低和最高校准浓度下的相对响应相似。这 种相似性表明了灌注系统的有效性。假设 灌注样品浓度和样品流速越高,含硫化合 物在样品流路中达到饱和的速度就越快。 如果灌注的系统闲置了数天,通常应弃去 待机后的前 2-3 次进样。后续进样可用 于定量分析。



图 2. 系统最初暴露于含硫化合物时的表现。各化合物的浓度为 200 ppb



图 3. 灌注后 50 ppb 下 8 次重复进样的叠加色谱图

色谱图

8355 SCD 是一种高选择性检测器,用于 分析痕量含硫化合物,不受烃类化合物的 干扰。它可以为此方法范围内的所有含 硫化合物提供等摩尔线性响应。将涂覆 4.2 μm 非极性固定相的 J&W DB-Sulfur SCD 色谱柱连接至 8355 SCD,用于分析 挥发性、极性和反应性含硫化合物。如 图 4 所示,整个系统可以为目标含硫化 合物提供良好的分离度、出色的峰形和灵 敏的响应。这种性能得益于惰性流路、低 流失以及更高的分析柱惰性。在 100 ppb 浓度下,各分析物中硫摩尔响应因子的 相对标准偏差 (%RSD) 为 12.1%,证明了 8355 SCD 对硫的等摩尔响应。

重现性和线性

重现性结果见表 4。采集了三种校准浓度 (低浓度、中等浓度和高浓度)下的所有 数据,每种浓度重复测定 8 次。如表 4 所示,15 ppb 校准品的平均峰面积 RSD 为 7.4%,最大值为 12.54%。15 ppb 非 常接近方法定量限,因此该浓度下平均 峰面积 RSD 为 7.4% 表明了出色的性能。 随着浓度增大,峰面积精度显著改善。 50 ppb 和 200 ppb 下的峰面积 RSDs 分 别为 1.77%-3.85% 和 0.87%-2.21%。

在 15-200 ppb 范围内的 7 种浓度水平下 评估了 7 种化合物的线性。这些含硫组 分的相关系数 (R²) 大于 0.998。图 5 显示 了目标化合物的校准曲线,表 5 显示了 每种化合物的详细结果。





表 4. 含硫化合物的重现性结果

		峰面积 RSD% (n = 8)		
编号	化合物	低浓度 (15 ppb)	中等浓度 (50 ppb)	高浓度 (200 ppb)
1	硫化氢	7.3	2.13	1.69
2	羰基硫	4.54	3.16	2.21
3	甲硫醇	5.72	3.85	1.67
4	乙硫醇	7.56	2.67	1.5
5	二甲硫醚	12.54	3.37	1.36
6	二硫化碳	4.76	1.77	0.87
7	噻吩	8.78	3.03	1.08



图 5. 所分析含硫化合物的校准曲线

衣 5. 含硫化合物的线性组

编号	化合物	保留时间 (min)	CF 公式	R ²
1	硫化氢	3.976	y = 2.2524x + 6.0381	0.9987
2	羰基硫	4.206	y = 2.8622x + 2.0716	0.9991
3	甲硫醇	5.193	y = 2.4045x + 3.9397	0.9998
4	乙硫醇	6.295	y = 1.9226x + 1.0020	0.9983
5	二甲硫醚	6.543	y = 2.6252x-2.1923	0.9986
6	二硫化碳	7.013	y = 5.5277x-9.1795	0.9993
7	噻吩	8.997	y = 2.7757x-0.2334	0.9991

检出限评估

对混合气体标样进行稀释,确定 7 种含硫 化合物在 8355 SCD 中的实际 LOD。图 6 中的色谱图显示了对 10 ppb(图 6A)和 15 ppb(图 6B)混标的响应。所有分析 物均可与基线噪音分离,并具有尖锐的峰 形。使用信噪比 (S/N) (ASTM)进行 LOD 评估,所有分析物在 10 ppb 和 15 ppb 下 的信噪比分别如图 6A 和 6B 所示。信噪 比远大于 3,意味着这些化合物的 LODs 低于 10 ppb。在图 6B 中,信噪比略大于 10,由此可以得出结论,各分析物的定 量限约为 15 ppb。

结论

Agilent 8890 气相色谱系统与 Agilent 8355 硫化学发光检测器联用,为含硫化 合物的分析提供了出色的线性和重现性。 本研究还评估了实际 LOD,表明整个系 统具有出色的灵敏度。整个系统的特征包 括惰性流路、通过挥发性物质分析接口连 接的进样阀、迷你气体混合器、Agilent J&W DB-Sulfur SCD 色谱柱和联用的 SCD,可确保对高纯度氢气中的痕量含硫 化合物进行准确定性和定量分析。

查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn

www.agilent.com

DE46212077

本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。

© 安捷伦科技(中国)有限公司,2023 2023 年 4 月 26 日,中国出版 5994-5864ZHCN



图 6. 低浓度硫标准品的色谱图和信噪比: (A) 10 ppb; (B) 15 ppb。峰归属信息见图 4

参考文献

- Xu, C.; Xu, G. Analysis Technology of Trace Impurities in Hydrogen for Hydrogen Fuel Cell Vehicles. *Chemical Industry* and Engineering Progress **2021**, 40(2), 688–702.DOI: 10.16085/ j.issn.1000-6613.2020-0690
- Bu, T. Hydrogen Impurity Analysis Using the Agilent 990 Micro GC (使用 Agilent 990 微型气相色谱仪 分析氢气杂质), 安捷伦科技公司 应用简报,出版号 5994-2138EN, 2020
- Li,W.使用 Agilent 8890 GC-PDHID 系统分析燃料电池氢和高纯氢中的 痕量二氧化碳和永久性气体杂质, 安捷伦科技公司应用简报,出版号 5994-4045ZHCN, 2021

